#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平6-193598

(43)公開日 平成6年(1994)7月12日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号

G

FΙ

技術表示箇所

F 0 4 D 29/58

F 0 4 C 2/00

8311-3H

庁内整理番号

審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平4-220428

平成 4年(1992) 8月19日

(71)出願人 000004097

日本原子力研究所

東京都千代田区内幸町2丁目2番2号

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目 6番地

(72)発明者 加藤 崇

茨城県那珂郡那珂町大字向山801番地の1

日本原子力研究所那珂研究所内

(72)発明者 河野 勝巳

茨城県那珂郡那珂町大字向山801番地の1

日本原子力研究所那珂研究所内

(74)代理人 弁理士 西澤 利夫

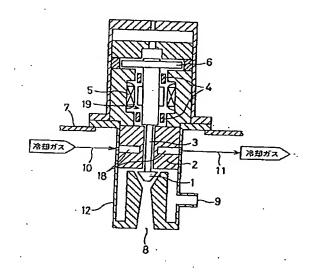
最終頁に続く

### (54)【発明の名称】 極低温回転機器

### (57)【要約】

【目的】侵入熱を低減させ、断熱効率の向上した極低温 回転機器を提供する。

【構成】インペラー1と、このインペラー1の背面部から軸受部4,6の間に挿入した断熱材2と、回転軸3の一部とをケーシング12内に収納し、かつ断熱材2の一部に、ケーシング12を貫通して液体窒素温度レベルまで冷却した、作動流体と同質の流体を供給し、前記断熱材2およびケーシング12を冷却する冷却ガス流路を形成する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 回転軸の一端部に設けたインベラーを極 低温領域で作動させるとともに、回転軸を支承する軸受 部を液体窒素温度レベルよりも高い状態に保持する極低 温回転機器において、インペラーと、このインペラーの 背面部から軸受部の間に挿入した断熱材と、回転軸の一 部とをケーシング内に収納し、かつ断熱材の一部に、ケ ーシングを貫通して液体窒素温度レベルまで冷却した、 作動流体と同質の流体を供給し、前記断熱材およびケー シングを冷却する冷却ガス流路を形成してなることを特 10 徴とする極低温回転機器。

【請求項2】 断熱材を冷却した流体を回転軸に沿って 軸受方向へ導き、かつその一部を軸受室内を介して外部 へ排出させる冷却ガスラインと、他の一部を軸受室の手 前より外部へ排出させる別の冷却ガスラインとを各々形 成してなる請求項1の極低温回転機器。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】との発明は、極低温回転機器に関 するものである。さらに詳しくは、この発明は、超臨界 20 ヘリウムで強制冷却を行う超臨界ヘリウム循環装置等に 使用される低温排気ポンプ、超臨界ヘリウムポンプなど の極低温回転機器に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、超臨界ヘリウム循環装置用の 極低温回転機器については、各種のものが提供されてき ており、たとえば、4K~4.2 Kのヘリウムを作動流体 とし、インペラーを回転させることにより作動流体を昇 圧させるポンプがこれまでに知られている。

【0003】このような極低温回転機器においては、軸 30 受部の温度レベルを常温とし、インペラー背面部と軸受 (ジャーナル軸受) 部との間に断熱板を設け、低温側へ 熱が侵入するのを防いでいる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 極低温回転機器は、一般に、比較的小型のものが多く、 現在のところ国内最大の処理流量の低温排気ポンプで も、その理論軸動力は350W程度に留まっている。と のため、外部から低温側への侵入熱量が断熱効率に大き く影響し、たとえば前述の低温排気ポンプの場合には、 侵入熱量Qしを50Wと仮定すると、流量Wは130g /s であることから、単位流量当りのエンタルピ<u>上</u>昇△ iは、次式より0.385 J/gとなる。

[0005]

【数1】

$$\Delta i = \frac{QL}{W}$$

【0006】理論エンタルピ上昇は、2.676 J/gであ るため、仮に侵入熱がない場合の断熱効率を0.7 とする gとなる。侵入熱(50W)の場合は、エンタルピ上昇 が3.823 + 0.385 = 4.208 J/s となり、断熱効率nad

[0007] 【数2】

$$\eta \text{ ad} = \frac{2.676}{4.208} = 0.636$$

【0008】となる。すなわち、侵入熱(50♥)の影 響で6.4 %効率が下がったことになる。一方、侵入熱量 は、軸受側温度とインペラー側温度の温度差、熱伝導部 の面積および熱伝導部の長さ(温度勾配のついている軸 方向長さ) に比例する。熱伝導部の面積は、設計仕様か らインペラー外径が決まれば、全体の大きさが決まるの で改善の余地は少ない。また、熱伝導部の長さを長くす ると、回転軸長さが長くなり、回転軸の共振点が下がる ため、これについても制限がある。

【0009】との発明は、以上の通りの事情に鑑みてな されたものであり、従来の極低温回転機器の欠点を解消 し、侵入熱を低減させ、断熱効率の向上した極低温回転 機器を提供することを目的としている。

[0010]

【課題を解決するための手段】との発明は、上記の目的 を実現するために、回転軸の一端部に設けたインペラー を極低温領域で作動させるとともに、回転軸を支承する 軸受部を液体窒素温度レベルよりも高い状態に保持する 極低温回転機器において、インペラーと、このインペラ 一の背面部から軸受部の間に挿入した断熱材と、回転軸 の一部とをケーシング内に収納し、かつ断熱材の一部 に、ケーシングを貫通して液体窒素温度レベルまで冷却 した、作動流体と同質の流体を供給し、前記断熱材およ びケーシングを冷却する冷却ガス流路を形成してなると とを特徴とする極低温回転機器を提供する。

[0011]

【作 用】この発明の極低温回転機器においては、作動 流体と同質の流体を液体窒素温度レベル(80K)まで 下げ、これを断熱材の一部へ供給することにより、断熱 材およびこの断熱材を収納するケーシングを冷却するこ とができる。断熱材とインペラーとの間の温度差が小さ 40 くなり、インペラー側への侵入熱量が低減される。

【0012】また、断熱材およびケーシングを冷却した 流体を回転軸の外径に沿って軸方向へ流すことにより、 回転軸や軸受室内も冷却され、軸受部での発熱等を抑止 し、所定の温度に保持することが可能となる。

[0013]

【実施例】以下図面に沿って実施例を示し、この発明の 極低温回転機器についてさらに詳しく説明する。図1 は、この発明の極低温回転機器の一実施例を示した断面 図である。この図1の例においては、インペラー(1) と、実際のエンタルビ上昇は2.676 / 0.7 = 3.823 J / 50 を一端部に装着した回転軸(3)の中央部および他端部 3

を、たとえば助圧型ガス軸受等のジャーナル軸受(4) およびスラスト軸受(6)により支承している。また、 回転軸(3)の駆動源として駆動用電動機(5)を配設 している。これらのジャーナル軸受(4)、スラスト軸 受(6)および電動機(5)については、それらの軸受 性能と電動機の耐寒温度の制限内(例えば-10℃以 内)で使用することができる。

【0014】たとえばHe等の極低温状態の作動流体 は、入口ノズル(8)より流入し、インペラー(1)で 昇圧された後、出口ノズル(9)より外部へ排出され る。インペラー(1)の背面部とジャーナル軸受(4) との間には、断熱材(2)を挿入しており、軸受部 (4)(6)側からインペラー(1)側への侵入熱を抑 止している。との断熱材(2)の一部には、その全周に わたって溝部(18)が設けられており、液体窒素温度 レベル(80K)付近まで冷却された、たとえばHeガ ス等の冷却ガスが供給される。この冷却ガスの供給は、 インペラー(1)、断熱材(2)および回転軸(3)の 一部を収納する深冷ケーシング(12)に設けた冷却ガ ス入口(10)を介して行われる。冷却ガスは、断熱材 20 (2)およびこの断熱材(2)を収納している深冷ケー シング(12)を冷却し、冷却ガス出口(11)より外 部へ排出される。

【0015】またこの例においては、インペラー(1)側のHe等の作動流体および軸受室(19)側との間に、冷却ガスの出入が発生しないような気密構造としてもいる。これによって、作動流体側の条件に関係せず、冷却ガスの圧力、流量等を調整自在とするできる。なお、極低温回転機器の本体は、この図1に例示した保冷容器取付面(7)上に取り付けられる。

【0016】以上からも明らかであるように、との保冷容器取付面(7)より下部は低温となり、上部は大気に触れているので常温となる。たとえば以上の構成とすることにより、断熱材(2)および深冷ケーシング(12)を液体窒素温度レベル(80K)まで冷却することができ、軸受室(19)側とインペラー(1)側の温度差を、常温(20℃)の場合に比べ、

[0017]

【数3】

$$\frac{80}{293-4} = 0.277$$

【0018】倍にするととができ、侵入熱の低減が図れる。図2は、との発明の極低温回転機器の別の例を示した断面図である。との図2の例においては、溝部(18)を断熱材(2)の外周および内周の両方に設けている。冷却ガス入口(10)より供給されたHe等の冷却ガスは、断熱材(2)およびこの断熱材(2)を収納する深冷ケーシング(12)を冷却した後に、回転軸(3)の外周に沿って流れ、その一部は、軸受室(19)を通り冷却ガス出口(15)より外部へ排出され

る。冷却ガスは、軸受室(19)を通過する際に、ジャーナル軸受(4)、スラスト軸受(6)および電動機(5)の発熱量を吸収することができる。

【0019】またこの例においては、軸受室(19)内の温度が、所定の温度以下にならないように温度計(13)を設け、との温度計(13)の信号により、温度調整弁(14)を作動させるようにしている。回転軸(3)の外周に沿って流れた、他の一部の冷却ガスは、冷却ガス出口(11)から外部へ排出される。との時、冷却ガスが、インペラー(1)側に洩れ込むと侵入熱の増加となるので、この例においては、インペラー(1)の出口圧力と冷却ガスの供給圧力を測定する差圧計(16)を設けてもいる。との差圧計(16)の値が所定の

圧力となるように、差圧調整弁(17)を作動させ、冷

却ガスがインベラー(1)側へ洩れ込むのを防止してい

る。
【0020】たとえば以上の構成により、断熱材
(2)、深冷ケーシング(12)および回転軸(3)
が、液体窒素温度レベルまで冷却されるため、侵入熱の
低減が図れる。また、軸受部(4)(6)および電動機
(5)の温度上昇を効果的に抑えることが可能となる。
その結果、電動機(5)に関しては、外部から冷却水等
で冷却する必要などがなくなる。

【0.021】もちろんこの発明は以上の例によって限定されることはない。細部については様々な態様が可能なことはいうまでもない。

[0022]

【発明の効果】以上詳しく説明した通り、との発明によって、侵入熱が低減した、高効率の極低温回転機器が提30 供される。回転軸も冷却可能となり、侵入熱をさらに低減させるととができる。軸受室内の軸受部および電動機の発熱を抑えることも可能となり、外部よりこれらの部位を冷却水で冷却する等の設備が不要となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の極低温回転機器の一実施例を示した 断面図である。

【図2】 この発明の別の例を示した断面図である。 【符号の説明】

- 1 インペラー
- 40 2 断熱材
  - 3 回転軸
  - 4 ジャーナル軸受
  - 5 駆動用電動機
  - 6 スラスト軸受
  - 7 保冷容器取付面
  - 8 作動流体入口ノズル
  - 9 作動流体出口ノズル
  - 10 冷却ガス入口
  - 11 冷却ガス出口
- 50 12 深冷ケーシング

5

13 温度計

14 温度調整弁

15 冷却ガス出口

16 差圧計

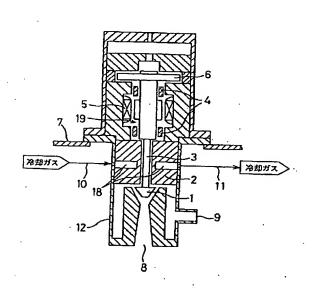
\*17 差圧調整弁

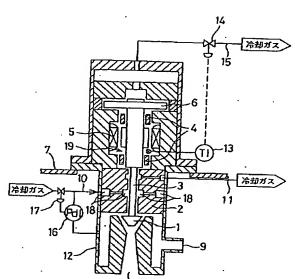
18 溝部

19 軸受室

\*

[図1]





【図2】

## フロントページの続き

(72)発明者 桧山 忠雄

茨城県那珂郡那珂町大字向山801番地の1 日本原子力研究所那珂研究所内

(72)発明者 吉田 純

山口県下松市東豊井794番地 株式会社日 立製作所笠戸工場内 (72)発明者 岡本 和夫

山口県下松市東豊井794番地 株式会社日立製作所笠戸工場内

(72)発明者 原田 進

茨城県土浦市神立町 502番地 株式会社日 立製作所機械研究所内

(72)発明者 松本 孝三

山口県下松市東豊井794番地 株式会社日

立製作所笠戸工場内